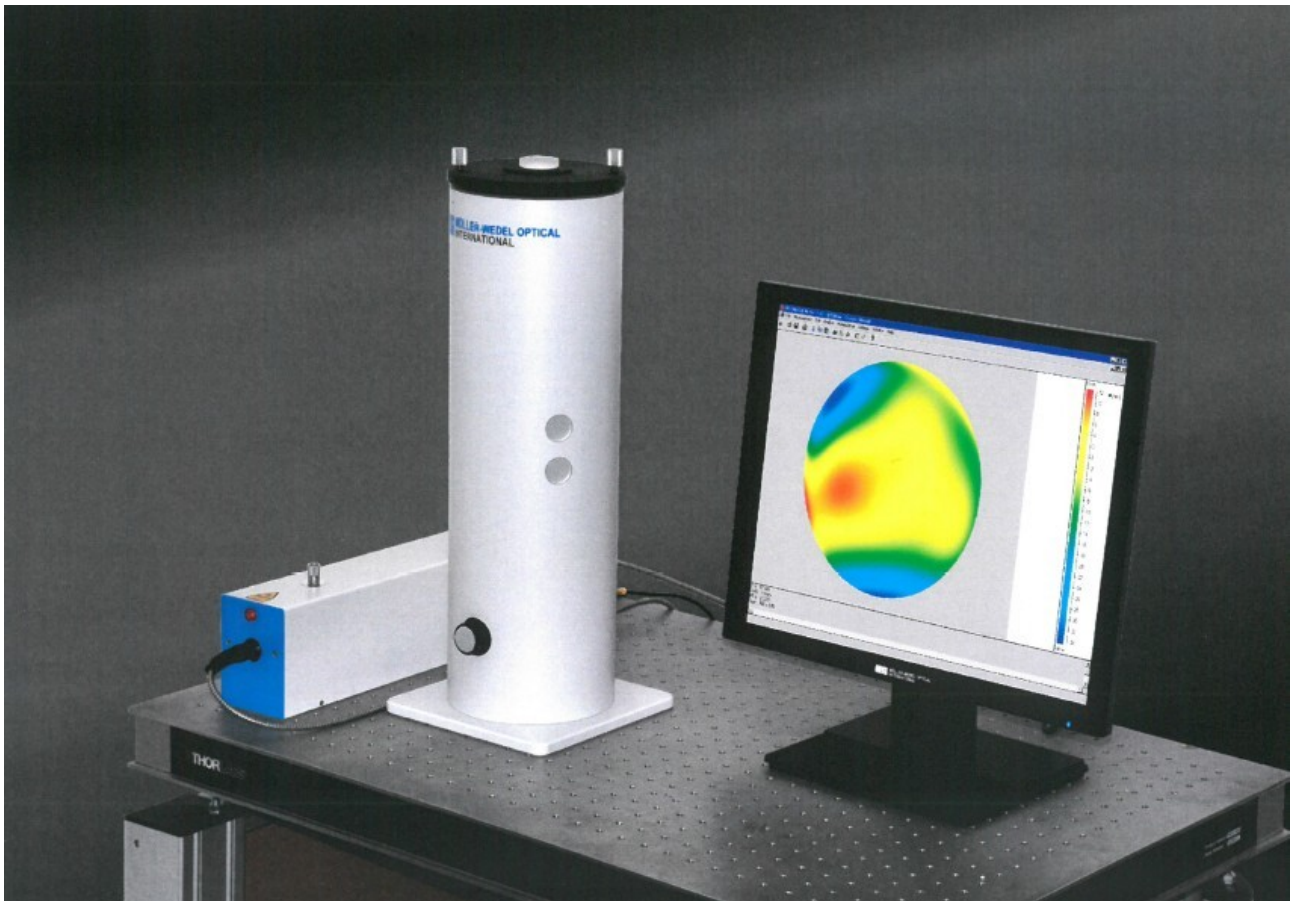


测试平面表面的干涉仪

干涉仪 VI-direct 50 PUL



MÖLLER-WEDEL OPTICAL GmbH

Rosengarten 8

D-22880 Wedel, Germany

Tel. +49 (0)4103-9377610

www.moeller-wedel-optical.com

info@moeller-wedel-optical.com

测试平面表面的干涉仪

干涉仪 VI-direct 50 PUL

应用领域

平面元件测试干涉仪 VI-direct 50 PUL 具有快速测试没有镀膜和反射镜平面元件的平面度功能, 由于其特定的干涉仪光路, 插入测试品后可以直接对测试品进行评价。无需再调整。

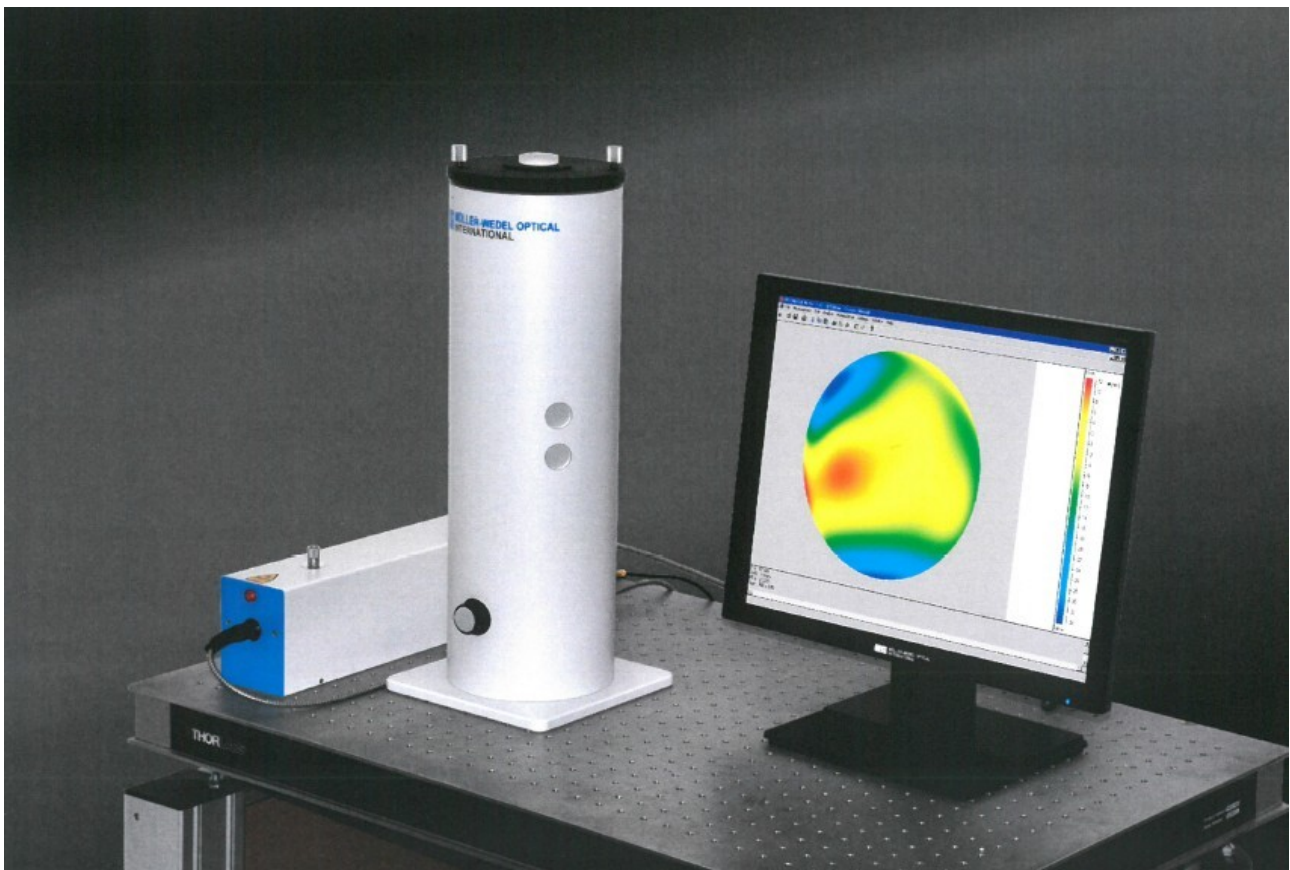
优点/特点

- 功能原理: 斐索干涉仪
- 可以快速预装调的搜索模式
- 测试口径: 12mm----50mm
- 使用简单方便
- 干涉图直接显示, 无需调整
- 可视或软件支持评价二者可选

硬件

干涉仪包括以下元件:

- 干涉仪 VI-direct 50 PUL 配有高分辨率 USB 相机 (分辨率: 1600×1200 像素)
- 带有倾斜俯仰可调的装夹装置
- 光纤耦合的氦氖激光器
- 配有主机一体化的监视器



Ord.No.	Description
244 915	Interferometer VI-direct 50 PUL
244 273	INTOMATIK-S USB WINDOWS Software for fringe processing

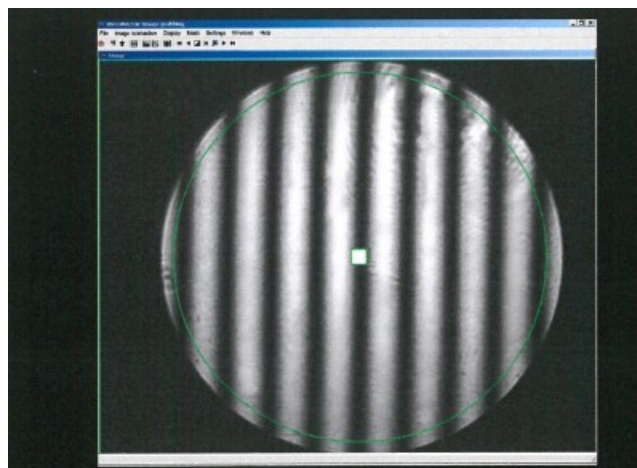
条纹处理软件 INTOMATIK-S

概述

- 根据 ISO 10110-5 张开条纹单拍干涉图像的评估
- 无需相移
- 操作系统 WINDOWS XP/7/8/10
- 可数字放大至 4 倍，从而利用相机全分辨率（1600×1200 像素）
- 由于曝光时间短，所以可以做到对震动不敏感
- 坐标单位可以选择像素，毫米或英寸
- 自动协议生成
- 输出结果格式为*.opd-format 或者原始数据供进一步处理

记录模式

- 稳定的动态干涉图显示，动态图像彩色超调变显示
- 大量掩摸选项
- 全息功能
- 强度分布存储为*.bmp 文件



评价模式

- 结果显示为轮廓，3D 或 2D 图
- 大量处理选项如平均，滤波和相位分布拟合

